# 激光扫描镜的应用研究

刘兴占 刘向东

(清华大学精密仪器与机械学系,北京,100084)

**摘要**: 就激光扫描技术中关键部件——扫描镜进行了应用研究,并对其在宽片磁带表面缺陷的检测系统中所采用的旋转多面体扫描镜进行了理论分析,推导出多面体扫描镜的设计公式及参数选择。

关键词: 激光扫描镜 多面体

## Using of laser scanning mirror

Liu Xingzhan, Liu Xiangdong (Department of Precision Instruments, Tsinghua University Beijing, 100084)

**Abstract:** The optical scanning mirror is a key component in laser scanning detection system. The purpose of the paper is to introduce the theoretical analysis, parameter selection and design method of the rotatory polyhedron scanning system. The fundamental requirements to construct a rotatory polyhedron scanning system are much high geometry or manufacture accuracy, very small rotatiry deformation of the rotation components. Finally, this paper discussed the scanning effectiveness, and point out that the selection of scanning effectiveness is in the range of 0. 4-0.6, and how to select other relative parameters.

Key words: laser scanning miror polyhedron



言

리

### 一、旋转多面体扫描镜<sup>[1,4]</sup>

激光扫描无论是哪种方式,都要有光学偏转器。实现此功能 的有振镜扫描、声光扫描、电光扫描和旋转多面体扫描。目前以旋 转多面体扫描应用最广泛。

1. 旋转多面体的优点: (1) 扫描角度大, 通常可大于 30°。(2) 在较长的扫描宽度上具有高的分辨率, 大约为 20~ 1000Line/ mm。(3) 反射面镀全反射膜、反射率高、光能损失小。(4) 实现扫 描机构简单。2. 旋转多面体的缺点: (1) 多面体的加工精度要求



Fig. 1 The geometry relationship of the rotatory polyhedron

高。(2)与多面体相关的光学部分调整复杂,精度要求高。(3)扫描电机的均匀性要求严格。 在扫描过程中,多面体的各个小平面反射面绕多面体中心 O 旋转,如图1所示,尽管转镜 以匀速旋转,反射光的扫描轨迹严格说不是匀角速度,扫描轨迹必然产生非线性误差。这误差 是由多面体反射面与其外接圆矢高  $\Delta R$  所引起的。  $\Delta R = R[1 - \cos(\alpha/2)]$  (1)



Fig. 2 An example of non-parallel of reflective plan and axis line

意两面之间的法向夹角积累误差。此误差会 引起扫描起点与终点不齐,或单线扫描纵向 间隔混乱,或多线扫描字符首尾不齐。(c)各 小平面与多面体轴线的不平行度。当其倾角 为Δ♀时,则产生位移量Δd(如图2所示), Δd称为倾斜线性误差,可用柱面镜修正,修 正原理如图3所示。由于多面体扫描镜转速 很高,如果采用单线扫描方式,对半径

起的。  $\Delta R = R[1 - \cos(\alpha/2)]$  (1) 3. 对旋转多面体扫描镜的要求。为了保证扫描系 统的精度要求,旋转多面体扫描镜应具有以下要 求:(1)旋转多面体的几何精度要高。多面体的几 何精度对扫描的影响主要有三种情况:(a)各小平 面与多面体轴线距离的误差。此误差影响多面体 的动平衡,在高速旋转中产生很大压力,影响扫描 运动精度。(b)相邻两小平面法向夹角误差及任





30mm, 厚度为 12mm, 材料密度为 ρ 的八面体, 以 20000/min 高速旋转, 对某一小平面与其轴 心线距离为 0.02mm, 将产生 0.785 ρN 的离心力。 (2) 多面体惯性小平面变形要小。在扫描 过程中, 多面体旋转速度很高, 每分钟达几万转、惯性小平面变形是影响光学机械零件性能的 最重要因素之一, 小平面上质点径向加速度 a<sub>n</sub> 与角速度 ω 之间的关系为: a<sub>n</sub> = R ω<sup>2</sup>

 $AR = R_{max}(1 - \cos \frac{\pi}{N})$ 若 n = 10000Rot/min, R = 40mm = 0.04m, 则  $\omega = 2\pi n = 1500$ arc/s,  $a_n = 0.04 \times 1500^2 = 90000$ m/s<sup>2</sup> 如多面体材料不均匀, 局部负载将引起很大径向力。故必须选择具有低变形的材料。另外, 可减小半径 R, 达到减小作用在小平面上的压力变化。小平面变形系数为  $\Delta R$ , 如图 4 所示, 当  $\alpha = 2\pi/N$ 

Fig. 4 Polyhedron(N 为多面体面数), 由(1) 式得  $\Delta R = R_{max}[1 - \cos(\nabla N)]$ (2)(2)由上式可知, 半径的变化量是多面体面数的函数。当 N=3 时,  $\Delta R=$ 

0.  $5R_{\max}$ , N = 4时,  $\Delta R = 0.3R_{\max}$ , N = 5时,  $\Delta R = 0.05R_{\max}$ , 而 N = 30时,  $\Delta R = 0.005R_{\max}$ .

与变形有关的力主要是径向力,  $F = ma_n$ , 由上分析可得:  $\Delta F \propto \Delta m \cdot R \propto \Delta R \cdot R \max$ 。而  $\Delta R \cdot R_{\max} = R_{\max}^2 [1 - \cos(\Im n)]$ 以  $R_{\max} \approx Nd/2\pi$ 代入, 则有:  $\Delta R \cdot R_{\max} = (N^2 d^2/4\pi^2)[1 - \cos(\pi/N)]$  (3) 将余弦函数展开, 取两项近似得:  $\Delta F \propto \Delta R \cdot R_{\max} = d^2/8$ 所以, 从惯性变形考虑, 多面体小平面的宽度 d 愈小愈好。

#### 二、旋转多面体扫描镜的设计计算<sup>[2,3,5]</sup>

我们采用高惯性局部照明的旋转多面体作为扫描偏转元件。如图 5 所示利用反射光进行 扫描, 当多面镜发生 Δθ 角位移时, 反射光发生 2Δθ 的角位移。当入射光照射到多面镜棱角 时, 反射光被分裂为两部分, 一部分继续完成扫描, 另一部分开始新的扫描。这时扫描光的强 度是变化的.实际上照明光束遇到多面镜棱角 这段时间形成扫描空程。所以,这种扫描是间 断的。多面镜的面数与扫描角有关。为减小扫 描空程.应加大每一反射面的线度,即加大多面 体的半径,使尺寸加大,但又受到扫描电机及转 速的限制,因此,合理设计多面镜就必须弄清扫 描角. 光斑尺寸. 扫描空程. 多面体半径及多面 镜数等之间的相互关系。



Fig. 5 Scanning principle

设光斑尺寸为 2  $ω_0$ , 旋转多面体半径为 R, 面数为 N, 一次扫描多面镜的角位移为 α(等于 反射光扫描角的一半),由图5所示,旋转多面体的一个镜面从 CK 开始扫描,到 GL 扫描结 束. 它们的位置分别用它们的法线 OD 和 OF 表示。

$$\Rightarrow \qquad X = \cos(360^\circ/N - \alpha) = \cos[360^\circ \alpha/(360^\circ \eta) - \alpha] = \cos[\alpha(1 - \eta)/\eta]$$

$$Y = \cos(180^{\circ}/N)\cos 45^{\circ} = \cos[180^{\circ} \alpha/(360^{\circ} \eta)]\cos 45^{\circ} = \cos(\alpha/2\eta)\cos 45^{\circ}$$

厕

2

=

=

$$R = \omega_0 \{ [1 + 2(X - 1)Y^2 - X^2] / [2(X - Y^2 + 1)] \}^{-1/2}$$
(8)  
(8)

$$= \omega \left\{ \frac{1 + 2[\cos(\alpha(1-\eta)/\eta) - 1][\cos(\alpha/2\eta)\cos45^{\circ}]^{2} - [\cos(\alpha(1-\eta)/\eta)]^{2}}{2[\cos\alpha(1-\eta)/\eta - (\cos(\alpha/2\eta)\cos45^{\circ})^{2} + 1]} \right\}^{-1/2}$$
(9)

根据给定的扫描角  $2\theta$ (相应的  $\alpha = \theta$ )和多面体扫描效率  $\eta$ 就可以根据上面的公式求出旋 转多面体的半径 R 和多面体的面数 N。因为是局部照明扫描,所以多面体的厚度应大于光束 的尺寸2ω。在给定扫描的情况下,在设计多面镜时,扫描效率多大才合理呢? 以 α= 18°为例 看一下多面镜半径 R 和面数N 如何随扫描效率 η 变化。当 α= 18,ω= 3.037mm, η 不同时

N 和R 列于附表。

理。



ning effectiveness n

而 ω= 3.037mm, 所以扫描用旋转多面 体半径 R = 28.02mm, 而多面体厚度 h 应大于 2 \omega\_0 = 2 × 3.037 = 6.074mm, 因 此,取 h= 8mm。旋转多面体材料用铝 合金。

至此,我们所采用的扫描器参数为: 扫描范围: *l*= 2 of = 2×(15°×π/180)× 503.7= 263.6mm; 扫描角: 2α= 30°; 扫 描光点直径: do= 0.1mm: 分辨率: 1/do = 10point/mm;扫描频率: 2000Hz;电机 转速: 20000Rot/min; 多面体面数: N 12; 多面体厚度: h = 8mm; 多面体小平 面反射率:> 85%;多面体外平面平面 度: < λ6; 多面体外接圆半径: R =

$\eta=~50\%$ .	$X = \cos[\alpha(1)]$	l – 1)/1	$y = \cos 15$	° =	0.9659
Y =	$\cos(\alpha/2\eta)\cos(\alpha/2\eta)$	$s45^\circ = o$	$\cos 15^{\circ} \cos 45^{\circ}$	5° =	0. 6830
<i>R</i> =	$\omega_0 \left[ \frac{1+2(X)}{2(X)} \right]$	$\frac{-1}{Y^2}$	$\frac{-X^2}{1}$	N.	<b>9.</b> 227 თ
:夕而					

		Table The parameter summary of scanning system					
	η	$N = \frac{360^{\circ} \eta}{\alpha}$	$x = \cos \frac{\alpha(1-\eta)}{\eta}$	$Y = \cos \frac{\alpha}{2\eta} \cos 45^\circ$	<i>R</i> (mm)		
	0.1	2	0.9511	0	3.07		
	0.2	4	0. 3090	0.5	5. 91		
	0.3	6	0. 7431	0. 6124	9. 93		
	0.4	8	0. 8910	0. 6533	15.45		
١	0.5	10	0.9511	0.6725	22.55		
V	0.6	12	0. 9781	0.6830	30.37		
	0.7	14	0. 9909	0. 6894	54.34		
	0.8	16	0. 9969	0. 6935	93.36		
	0.9	18	0. 9994	0. 6964	212.67		
	1.0	20	1	0. 6983	∞		

**R**-□曲线如图 6 所示,由图可见,当 心 0.7 后, R 随 □ 增大而迅速增大。当  $\eta$ <sup>→</sup> 1 时, R<sup>→</sup> ∞。多面体半径太大,

面数多,这给加工和安装调试带来很大困难,所以我们认为

在上面给定的条件下,扫描效率在 0.4~ 0.6 之间比较合

一些余量, 20 取 30°, 所以 α= 15°, 面数 N = 12, 扫描效率

本系统扫描宽度 200mm, 转镜扫描角 20= 22.7°. 给出

30mm。我们用此扫描镜在宽片磁带表面缺陷的检测系统中应用效果很好。

#### 文 献 考

- 1 陈海清.光学仪器,1986;8(4):17
- 2 宋贤球, 龚育良, 徐文华. 北京钢铁学院学报, 1983; (4): 136
- 3 戚元燧,汪麟祥.光学仪器,1982;4(4):43
- 4 郑锦辉.应用激光,1986;16(3):97
- 刘向东.宽片磁带表面缺陷在线检测仪的研究.清华大学硕士论文 10130139401, 1994 5

作者简介: 刘兴占, 男, 1941年出生。副教授。1967年至1970年赴柬埔寨磅湛王家大学任教, 1983年至1985年赴法国 贝藏松大学光学与信号处理研究室进修,并获硕士学位。1995年~1996年赴法国巴黎第六大学作高访,从事 LIGA纳米技 术研究.先后主持和参加十几项科学研究.涉及计量测试技术、激光应用技术、信号处理及检测技术、纳米技术等。

收稿日期: 1997-06-16 收到修改稿日期: 1998-03-24